## 回路修正サービス

## 当社では集束イオンビーム加工装置(FIB加工装置)を使用した回路修正サービスを提供しています

- ・デバイスの内部信号を観察したい。
- ・マスク改版前に回路修正内容の有効性を確認したい。
- ・マスク改版を行わないで、特性の違うサンプルを作成したい。

などのご要望に対応いたします。

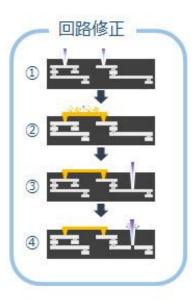
### FIB加工装置で出来る事

- 1. 絶縁膜を削る
- 2. 配線(アルミ,銅)を削る
- 3. 導体を成膜する
- 4. 絶縁膜を成膜する

当社が所有するFIB加工装置は回路修正に特化した仕様となっており、6種類のガスを搭載、加工内容に合わせてガスを使い分けることにより、高速かつ精度よく回路修正を行う事ができます。

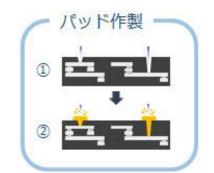
その他にも以下に対応しております。

- ・Cu配線、Low-K膜に対応
- ・各種パッケージ、ウェーハー(6,8インチ)、チップ状態での加工に対応
- ・CADデータ(GDS II フォーマット)を使用した加工位置へのナビゲーション
- ・ICパッケージ開封、ポリイミド剥離などの前処理からFIB加工まで一貫した作業を請け負う事も可能



#### 工程

- ① 接続対象配線を露出 (絶縁膜ミリング用ガスを使用)
- ② 2つの配線を接続 (導体デポジションガスを使用)
- ③ 切断対象配線を露出 (絶線膜ミリング用ガスを使用)
- ④ 露出した配線を切断 (メタルミリング用ガスを使用)



#### T<sub>程</sub>

- ① 対象配線を露出 (絶縁膜ミリング用ガスを使用)
- ② 導体を埋込、パッドを形成 (導体デポジションガスを使用)

## 回路修正サービスのお問い合わせ

回路修正サービスのご相談、ご依頼は下記へお問い合わせください。

TEDS-fa-service@ml.toshiba.co.jp



# **TOSHIBA**

\*本資料に記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。